課題番号 :F-13-RO-0042

利用形態 :機器利用

利用課題名(日本語) :低温成長 GaAs 系半導体薄膜の結晶構造評価

Program Title (English) :Analysis of crystal structure of low-temperature-grown GaAs-based

semiconductor thin films

利用者名(日本語) :富永 依里子

Username (English) : Yoriko Tominaga

所属名(日本語) :広島大学大学院先端物質科学研究科

Affiliation (English) : Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University

### 1. 概要(Summary)

本課題では、光通信帯光源が利用可能なテラヘルツ (THz)波発生検出用光伝導アンテナ(PCA)用低温成長 GaAs 系半導体の結晶構造の解析を、X 線回折(XRD) 法を用いて行った。

THz 分野では、低コスト化・省スペース化を達成した THz 時間領域分光システムの開発が望まれている。本システムの代表的な THz 波発生検出素子として、 $0.8~\mu$  m 帯に波長を有する Ti:Sapphire レーザを光源とした低温成長 GaAs から成る PCA が挙げられる。近年、この光源に  $1.5~\mu$  m 帯に波長を有する小型で比較的安価な超短パルスファイバーレーザが用いられつつある。本課題は、本光源が利用可能な高効率 THz 波発生検出用 PCA の実現を最終目的としたものである。

#### 2. 実験 (Experimental)

InP 基板上に分子線エピタキシャル法を用いて 200-240  $\mathbb{C}$  の範囲で成長した厚さ  $2~\mu$  m の低温成長 In $_{0.45}$  Ga $_{0.55}$  As の結晶性を、薄膜構造評価 X 線回折装置を 用いて評価した。また、 $220~\mathbb{C}$ で成長した In $_{0.45}$  Ga $_{0.55}$  As を成長後に水素雰囲気中・550  $\mathbb{C}$ で1時間アニールした。

## 3. 結果と考察(Results and Discussion)

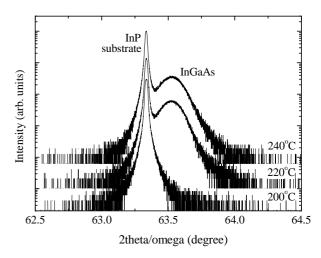


Figure 1 XRD spectra of low-temperature-grown  $In_{0.45}Ga_{0.55}As$ .

られる。

#### 4. その他・特記事項(Others)

本課題の遂行に際し、XRD 測定にご協力くださいました広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所の佐藤 旦氏、黒木伸一郎准教授に感謝申し上げます。

(参考文献) [1] R. A. Metzger et al., J. Vac. Sci. Technol. B, 11, (1993).

#### 5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)

- (1) <u>富永依里子</u>, 冨保勇貴, 角屋豊,『InP 基板上低温成長 In<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As の結晶構造の解析』, 2014 年 第 61 回応用物理学会春季学術講演会, 18a-E11-3, 青山学院大学相模原キャンパス, 平成 26 年 3 月 18 日.
- (2) <u>Yoriko Tominaga</u>, Yuki Tomiyasu, Yutaka Kadoya, "Investigation of crystal structure of low-temperature-grown In<sub>0.45</sub>Ga<sub>0.55</sub>As", The 41st International Symposium on Compound Semiconductor (ISCS2014), Montpellier, France, 平成 26 年 5 月 12 日発表予定(採択決定済).

# 6. 関連特許(Patent) なし。